

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【公開番号】特開2004-335446(P2004-335446A)

【公開日】平成16年11月25日(2004.11.25)

【年通号数】公開・登録公報2004-046

【出願番号】特願2004-56936(P2004-56936)

【国際特許分類】

H 01 T	13/20	(2006.01)
B 21 C	1/00	(2006.01)
C 22 C	5/04	(2006.01)
C 22 F	1/14	(2006.01)
H 01 T	13/39	(2006.01)
H 01 T	21/02	(2006.01)
C 22 F	1/00	(2006.01)

【F I】

H 01 T	13/20	E
B 21 C	1/00	L
B 21 C	1/00	M
C 22 C	5/04	
C 22 F	1/14	
H 01 T	13/39	
H 01 T	21/02	
C 22 F	1/00	6 2 5
C 22 F	1/00	6 8 2
C 22 F	1/00	6 8 3
C 22 F	1/00	6 9 4

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月9日(2008.6.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

中心電極(3)と、

前記中心電極(3)の先端部(3a)を露出させた状態で前記中心電極(3)の周囲を覆う絶縁体(2)と、

前記絶縁体(2)を保持する主体金具(1)と、

前記主体金具(1)に固定され、前記中心電極(3)の前記先端部(3a)との間で、放電ギャップ(g)を形成する対向部(4a)を有する接地電極(4)とを備えるスパークプラグであって、

前記中心電極(3)の先端部(3a)、および、前記接地電極(4)の前記対向部(4a)の少なくとも一方に接合される貴金属放電チップ(51、52)は、

イリジウム以外の金属成分の含有率が0.5質量%以上35質量%以下であるイリジウム合金のインゴットを圧延する圧延工程を経た後、伸線加工を施して、断面積0.05mm²以上1.2mm²以下の線材を形成し、該線材を所定長さに切断して得られる貴金属放

電チップ(51、52)の製造方法において、

前記伸線加工は、伸線加工に使用するダイス(101)の被加工材(102)が挿入される側の面である被加工材挿入面(101a)から被加工材(102)の進行方向手前60mm以内の加熱範囲(103)を連続して赤熱及び/又は白熱加熱し、該面の手前20mmの温度測定位置(105)において被加工材(102)が1000以上1150以下に加熱され、かつ、前記温度測定位置(105)から前記ダイス(101)の前記被加工材挿入面(101a)までの範囲(106)における温度が1000以上とされ、かつ、伸線速度が、1300mm/分以上1600mm/分以下であることを特徴とする貴金属放電チップ(51、52)の製造方法。

【請求項2】

前記金属成分は、少なくともニッケルである請求項1に記載の貴金属放電チップ(51、52)の製造方法。

【請求項3】

請求項1または2に記載の貴金属放電チップ(51)を用いて、前記中心電極(3)の先端部(3a)、および、前記接地電極(4)の前記対向部(4a)の少なくとも一方に、該貴金属放電チップ(51、52)を接合するスパークプラグの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

上記課題を解決するために、スパークプラグの中心電極の先端部、および、前記接地電極の前記対向部の少なくとも一方に接合される貴金属放電チップの製造方法は、イリジウム以外の金属成分の含有率が0.5質量%以上35質量%以下であるイリジウム合金のインゴットを圧延する圧延工程を経た後、伸線加工を施して、断面積0.05mm²以上1.2mm²以下の線材を形成し、該線材を所定長さに切断して得られるものである。